

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成22年7月22日(2010.7.22)

【公開番号】特開2008-310233(P2008-310233A)
 【公開日】平成20年12月25日(2008.12.25)
 【年通号数】公開・登録公報2008-051
 【出願番号】特願2007-160040(P2007-160040)
 【国際特許分類】

G 0 3 B 7/099 (2006.01)
 G 0 3 B 7/28 (2006.01)
 G 0 3 B 7/16 (2006.01)
 G 0 3 B 15/05 (2006.01)
 G 0 3 B 15/03 (2006.01)
 H 0 4 N 5/238 (2006.01)
 H 0 4 N 101/00 (2006.01)

【F I】

G 0 3 B 7/099
 G 0 3 B 7/28
 G 0 3 B 7/16
 G 0 3 B 15/05
 G 0 3 B 15/03 F
 H 0 4 N 5/238 Z
 H 0 4 N 101:00

【手続補正書】
 【提出日】平成22年6月3日(2010.6.3)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項1】

n個(但し、nは2以上の整数)の測光領域を有する測光センサと、
フラッシュ撮影前に、当該フラッシュ撮影に用いられる発光部に対して第1の予備発光を行わせる発光制御手段と、
 前記第1の予備発光中に、前記n個の測光領域各々において被写界からの反射光の強さを検出する測光手段と、
前記測光領域各々において検出された反射光の強さに基づいて、前記n個の測光領域の中から前記反射光が照射されるm個(但し、mはn未満の自然数)の測光領域を、前記被写界からの光量に係る測光信号を取得する測光対象領域として選択する測光領域選択手段と
を有する撮像装置。

【請求項2】

前記フラッシュ撮影における前記発光部の本発光量を決定する調光手段
をさらに有し、
 前記発光制御手段は、前記フラッシュ撮影前であって前記第1の予備発光の後に、前記発光部に対して第2の予備発光を行わせるとともに、
 前記測光手段は、前記第2の予備発光中において、前記測光対象領域から前記測光信号

を取得し、

前記調光手段は、前記測光信号に応じて前記本発光量を決定する

請求項 1 に記載の撮像装置。

【請求項 3】

前記測光領域選択手段は、前記 n 個の測光領域の中から、前記第 1 の予備発光による被写界からの反射光が多い前記 m 個の測光領域を前記測光対象領域として選択する

請求項 1 に記載の撮像装置。

【請求項 4】

前記測光領域選択手段は、前記 n 個の測光領域のうち撮影領域に設定された測距エリアの近傍に存在する複数の測光領域の中から、前記第 1 の予備発光による被写界からの反射光が多い前記 m 個の測光領域を前記測光対象領域として選択する

請求項 1 に記載の撮像装置。

【請求項 5】

前記第 1 の予備発光は、略一定の発光強度で所定時間行われるフラット発光である

請求項 1 に記載の撮像装置。

【請求項 6】

前記第 1 の予備発光は、所定回数連続的に繰り返されるパルス発光である

請求項 1 に記載の撮像装置。

【請求項 7】

a) フラッシュ撮影前に、当該フラッシュ撮影に用いられる発光部に対して第 1 の予備発光を行わせる工程と、

b) 前記第 1 の予備発光中に、測光センサが有する n 個（但し、n は 2 以上の整数）の測光領域各々において被写界からの反射光の強さを検出する工程と、

c) 前記測光領域各々において検出された反射光の強さに基づいて、前記 n 個の測光領域の中から前記反射光が照射される m 個（但し、m は n 未満の自然数）の測光領域を、前記被写界からの光量に係る測光信号を取得する測光対象領域として選択する工程と

を有する測光領域特定方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

かかる課題を解決するため本発明の撮像装置においては、n 個（但し、n は 2 以上の整数）の測光領域を有する測光センサと、フラッシュ撮影前に、当該フラッシュ撮影に用いられる発光部に対して第 1 の予備発光を行わせる発光制御手段と、前記第 1 の予備発光中に、前記 n 個の測光領域各々において被写界からの反射光の強さを検出する測光手段と、前記測光領域各々において検出された反射光の強さに基づいて、前記 n 個の測光領域の中から前記反射光が照射される m 個（但し、m は n 未満の自然数）の測光領域を、前記被写界からの光量に係る測光信号を取得する測光対象領域として選択する測光領域選択手段とを設けるようにした。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

また本発明の測光領域特定方法においては、a) フラッシュ撮影前に、当該フラッシュ撮影に用いられる発光部に対して第 1 の予備発光を行わせる工程と、b) 前記第 1 の予備発光中に、測光センサが有する n 個（但し、n は 2 以上の整数）の測光領域各々において

被写界からの反射光の強さを検出する工程と、c) 前記測光領域各々において検出された反射光の強さに基づいて、前記 n 個の測光領域の中から前記反射光が照射される m 個（但し、 m は n 未満の自然数）の測光領域を、前記被写界からの光量に係る測光信号を取得する測光対象領域として選択する工程とを設けるようにした。